

商品紹介

新シリンダーキャビネット「U-NACS」シリーズ

New Cylinder Cabinet “U-NACS” Series

1. はじめに

近年、半導体工場や液晶工場では、ウェハの大口径化や液晶基板の大型化に伴い、ガスの需要が増加してきている。また、LSIの高性能化や多機能化による新たな薄膜材料の採用により、使用する特殊材料ガスの種類も増加している。

このような背景のもと、ガスの安定供給や安全性に対して明確なコンセプトが求められており、当社では、このような新たなる時代の要請に対応した究極(Ultimate)のシリンダーキャビネット「U-NACS」シリーズを商品化した。

2. 背景

特殊材料ガスの供給ユニットであるシリンダーキャビネットは、半導体製造に不可欠な機器であり、ガスの安定供給、安全性、低コストの全てが要求される。当社ではこれまで、時代の要請に沿って表1に示すように様々なシリンダーキャビネットを販売し、数多くの実績を積んできた。

これまでの標準品として採用部品の標準化を徹底し短納期対応ができる「NACS-G2」、拡張性を重視した「NACS-Forest」、および客先ニーズに幅広く対応できる「NACS-G」があったが、製品毎に設計思想が独立していた。そこで設計思想の統一を図るとともに、蒸気圧などガスの物性に順応した供給機能を装備し、また、少量から多量に至る一連のガス供給が可能な新シリンダーキャビネット「U-NACS」を市場投入した。

表1 主なシリンダーキャビネットの変遷

年	～1996	1995～2004	2004～
製品名	LNX J/D1 J/D2	NACS-G NACS-G2 NACS-Forest	U-NACS Series
	Cabity		

3. 特長

- (1) 統一感のある洗練されたデザインを採用している。
- (2) 1本の容器からカードルによる供給まで、統一し

た思想でのガス供給を可能にした。

- (3) 筐体、部品や制御ソフトなど徹底した標準化とともに、製造拠点の統一化により、全体のコスト低減を可能にした。
- (4) Multipleタイプは、供給を停止することなく同種のガスキャビネットを拡張できる。
- (5) オプションの温調機「Breeze Unit」を採用することにより、NH₃などの低蒸気圧ガスも安定供給できる。
- (6) 多様化するユーザーニーズに対して、標準オプションにより対応できる。

4. 仕様

表2にU-NACSシリーズの仕様を、図1にU-NACS Doubleの外観を示す。

表2 U-NACS Series仕様

型式	形態	寸法(mm)
Single	1本立て	W500×D650×H2150
Double	2本立て	W800×D650×H2150
Multiple	3本立て以上 カードル設備	条件により Single 筐体を 組合せてシステム化
Breeze Unit	オプション 温調器	W350×D650×H2150 (U-NACS Double に併設)



図1 U-NACS Double 外観

(関東支社京浜支店 川元 淳)

問い合わせ先
電子機材事業本部半導体機器事業部半導体機器営業部
Tel. 03-5788-8470